

φ300 mm 対応 EFEM SSY

JEL
JEL CORPORATION

特徴 FEATURES

ツインアームロボットの
アーム斜め動作による受け渡しにより、
ロボット単体で2ポート迄を対応。

更に、走行軸との組合せや
水平多関節ロボット等、弊社の様々な
ロボットバリエーションからの選択により、
3ポート以上のレイアウト対応も可能。

- **保持方法:** 真空吸着
(その他保持も対応可)
- **通信仕様:**
GEM300等対応可
- **対象ウェーハ:**
φ300 mm以外も
カスタマイズ対応可



真空搬送ロボット STVCR

JEL
JEL CORPORATION

特徴 FEATURES

真空環境下でφ300 mmまでの
各種搬送に適したロングセラー機。

ツインアーム採用による
ワーク入れ替え時間短縮、
接触型樹脂パッドによるワーク保持で
高速搬送とスループット向上。

- **真空シール:**
磁性流体シール及び、
ベローズ仕様
- **真空度:** 1.33×10^{-6} Pa
- **保持方式:** 落とし込み、
接触型樹脂パッドによる
摩擦保持
- **アーム長、昇降ストローク:**
お問い合わせ下さい
- **オプション:**
位置補正機能対応可



PLP対応搬送ロボット JFR

JEL
JEL CORPORATION

特徴 FEATURES

PLPサイズ600 mm×600 mm、
最大4kgを平行配置したレイアウトで、
高速、低振動で搬送対応。

ロボット単体で2ポート対応可能となる
水平多関節ロボット。

ロボットハンドに
非接触アライメント機能を搭載し、
ロボット単体でワーク位置決めが可能。

- 対応サイズ:
510 mm×515 mm、
600 mm×600 mm
質量最大 4kg
厚み最大 3 mm
- 保持方式: 真空吸着
(その他保持も対応可)



高精度アライナ SAL-HV JEL

JEL CORPORATION

特徴 FEATURES

多種多様なワークの検出に加え、
従来の2倍の精度で位置決め。

プリアライナの性格上、
従来比2倍の高精度、従来精度の
2ターンのモード切替が可能。

●精度:

[高精度モード]

センタリング ±0.05 mm以内
ノッチロケート ±0.05度以内
位置決め時間 約8秒

[通常モード]

センタリング ±0.1 mm以内
ノッチロケート ±0.1度以内
位置決め時間 約3秒

- 保持方式: 真空吸着



SSY

JEL
JEL CORPORATION

EFEM with $\phi 300$ mm

FEATURES

2 ports access is available by path-planning.

By combining our diverse range of robots, such as track-axis and horizontal multi-joint robots, access to more than 3 ports is also available.

- **Holding Method:**
Vacuum suction
(other methods are also available)
- **Communication with factory host:**
GEM300 standards
- **Wafer size:**
Customizable for wafers other than $\phi 300$ mm



STVCR

JEL
JEL CORPORATION

Vacuum Wafer Transfer Robot

FEATURES

Long-selling robot to handle various types of wafers up to $\phi 300$ mm in vacuum environment.

Twin arm reduces the wafer swap time. High-speed transfer and improved throughput with contact type resin pads.

- **Vacuum sealing:**
Magnetic fluid sealing and bellows are used
- **Vacuum resistance:**
 1.33×10^{-6} Pa
- **Holding Method:**
Passive edge, friction holding by resin pads
- **Arm length, Z-axis stroke:**
Please ask JEL.
- **Options:**
Position corrective function



JFR

JEL
JEL CORPORATION

PLP Transfer Robot

FEATURES

PLP (600 mm x 600 mm, Max.4kg)
can be transferred in a parallel layout
with high-speed and low vibration.

Horizontal and multi-joint robot to
access 2 ports.

With non-contact alignment
function in the robot hand, the robot
alone can position the PLP.

- **Panel size:**
510 mm x 515 mm,
600 mm x 600 mm
Maximum weight: 4kg
Maximum
thickness: 3 mm
- **Holding Method:**
Vacuum suction
(other methods are
also available)



SAL-HV

JEL
JEL CORPORATION

High Accuracy Pre-Aligner

FEATURES

In addition to detecting a wide variety
of wafers, it supports positioning
with twice the accuracy compared
to the existing model.

Switchable two modes: high accuracy mode
(twice the accuracy of normal mode)
and normal mode.

- **Accuracy:**
[High accuracy mode]
Centering: Within ± 0.05 mm
Notch locating: Within ± 0.05 degrees
Positioning time:
Approx. 8 sec.
[Normal mode]
Centering:
Within ± 0.1 mm
Notch locating:
Within ± 0.1 degrees
Positioning time:
Approx. 3 sec.
- **Holding Method:**
Vacuum suction

